2003. Том 44, № 4 Июль – август С. 766 – 768

## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 541.49+548.734

© 2003 С.А. Громилов<sup>1</sup>\*, Д.Ю. Емельянов<sup>2</sup>, А.В. Кузьмин<sup>2</sup>, С.А. Прохорова<sup>1</sup>

## СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОЕВ ОКТАКИС-(ТРИМЕТИЛСИЛОКСИ)ОКТАСИЛСЕСКВИОКСАНА

1 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

<sup>2</sup> Новосибирский государственный университет

Статья поступила 27 марта 2002 г.

Проведено рентгенографическое исследование (ДРОН-RM4, R=192 мм,  $CuK_{\alpha}$ -излучение) и анализ структурной организации слоев октакис-(триметилсилокси)октасилсескви-оксана —  $[(CH_3)_3SiO]_8(SiO_{1,5})_8$ . Установлено, что, независимо от типа использованных подложек, слои этого соединения, полученные газофазным осаждением, представляют собой идеально ориентированные поликристаллические пленки в направлении [001]. На основании анализа кристаллической структуры в указанном направлении определен тип плоской решетки, которой следуют молекулы.

Ключевые слова: рентгеновская дифракция, поликристаллы, летучие соединения.

Кремнийорганические соединения типа октаорганилсилсесквиоксанов являются перспективными материалами для вакуумной литографии и используются в качестве фото-, электроно- и рентгенорезистов [1]. Они могут осаждаться на различные подложки путем термического испарения в вакууме (сублимацией), чувствительны к различным видам облучения, наилучшее разрешение для электронных резистов 50 нм [2].

Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению олигоорганилсилсесквиоксанов и широкое их использование, закономерности в ряду "кристаллоструктурная организация слоя — физико-химические свойства" ранее практически не обсуждались. Кристаллохимическое изучение структурной организации адсорбированных слоев, на наш взгляд, может прояснить на молекулярном уровне механизмы процессов, протекающих на поверхности, и использовать их при разработке физико-химических основ получения изделий с заданными характеристиками.

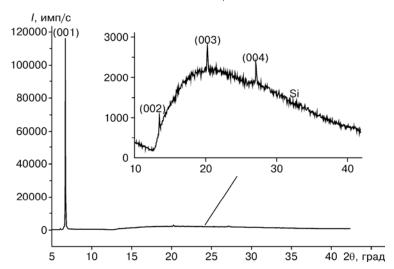
Настоящая работа посвящена исследованию слоев октакис-(триметилсилокси)октасилсесквиоксана —  $(Me_3SiO)_8(SiO_{1,5})_8$ . Брутто-формула этого соединения  $C_{24}H_{72}O_{20}Si_{16}$ , далее в тексте мы будем употреблять также сокращенное обозначение —  $AT_8$ . Синтез данного вещества описан в работе [ 3 ]. Кристаллическая структура  $AT_8$  была исследована методом рентгеноструктурного анализа монокристалла [ 4 ]. Нами исследованы ориентированные поликристаллические образцы. Анализ таких образцов позволяет перейти от трехмерной кристаллической структуры к ее двумерному сечению, т.е. выделенной кристаллографической плоскости. Выводы данной работы базируются на результатах рентгенографического анализа, что не исключает в дальнейшем привлечение более "тонких" методов, таких как, например, электронная микроскопия, EXAFS и др.

Экспериментальная часть. Слои  $AT_8$  были получены конденсацией паров (вакуумная установка HBA-1 фирмы Carl Zeiss Jena, вакуум  $\sim 10^{-5}$  мм рт. ст., источник открытого типа, температура  $140\pm 10$  °C) на различных подложках — пластинки Si, подложки из плавленного кварца

\_

<sup>\*</sup> E-mail: grom@che.nsk.su

краткие сообщения 767



*Puc. 1.* Дифрактограмма образца  $AT_8$  на полированной поверхности Si подложки. На выноске показан участок 10— $40^{\circ}$   $2\theta$ 

и др. Подложки имели комнатную температуру. Скорость нанесения составляла  $\sim 30 \text{ Å/c}$ , конечная толщина слоев  $0.5 \div 1 \text{ мкм}$ .

Образцы представляли собой тонкий ровный сплошной бесцветный прозрачный слой (диаметр пятна примерно 1 см) на указанных подложках. Подложки крепили при помощи пластилина на кварцевой кювете из набора гониометра ГУР-8. Плоскость образца и верхней поверхности указанной кюветы совмещали с помощью стеклянной пластинки.

Рентгенографическое исследование проведено на дифрактометре ДРОН-RM4 (R = 192 мм,  $CuK_{\alpha}$ -излучение, Ni-фильтр, детектор сцинтилляционный с амплитудной дискриминацией) в области углов 20 от 5 до 40° при комнатной температуре. Полученная дифрактограмма (рис. 1) представлена порядками отражений только от одной кристаллографической плоскости. Это свидетельствует об идеальной ориентации всех кристаллитов относительно подложки.

**Обсуждение результатов и выводы.** Индицирование дифрактограмм проведено по данным работы [4]. Из сравнения теоретической дифрактограммы  $(a=11,046,\ b=11,104,\ c=13,554\ \text{Å},\ \alpha=77,68,\ \beta=82,08,\ \gamma=84,04^\circ,\ пространственная группа $P\overline{1}$) с экспериментальной мы сделали вывод об идеальной ориентации кристаллитов во всех изученных образцах в направлении [001]. Особо следует отметить, что выделенное направление характеризуется наибольшим из имеющихся в кристаллической решетке межплоскостным расстоянием <math>d=13,15\ \text{Å},\$ соответственно эти слои наиболее заселены атомами. На такую особенность строения слоев других летучих соединений, в том числе октаорганилсилсесквиоксанов [CH<sub>3</sub>SiO<sub>1,5</sub>]<sub>8</sub> (метил-T<sub>8</sub>), [C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>SiO<sub>1,5</sub>]<sub>8</sub> (винил-T<sub>8</sub>) и [C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SiO<sub>1,5</sub>]<sub>8</sub> (этил-T<sub>8</sub>), мы указывали ранее в [5].

Установленная ориентация кристаллитов, а также рентгеноструктурные данные [4] для  $AT_8$  позволяют провести анализ структурной организации наиболее развитых верхних граней. Для этого в кристаллической структуре  $AT_8$  выделим плоскость, нормаль к которой совпадает с выделенным направлением [001]. На рис. 2 показан слой комплексов, параллельный семейству кристаллографических плоскостей (001). Выделенное направление перпендикулярно плоскости рисунка. Рост пленки происходит за счет повторения таких слоев через межплоскостное расстояние  $d_{001}$ .

В работе [ 5 ] было изучено строение слоев ряда других октаорганилсилсесквиоксанов. Было установлено, что, независимо от типа использованных подложек (полированные пластинки из плавленного кварца, стекла и монокристаллического кремния разной ориентации, а также подслои β-дикетоната и фталоцианина меди и др.), полученные слои представляют собой ориентированные поликристаллические пленки. В таблице представлены некоторые характеристики исследованных октаорганилсилсесквиоксанов. Как видим, геометрические характеристики

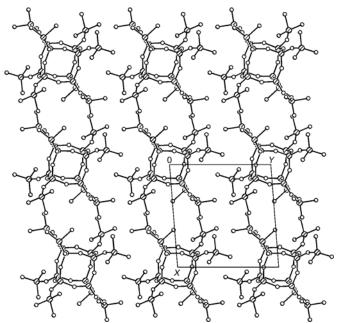


Рис. 2. Организация выделенных слоев в кристаллической структуре AT<sub>8</sub> в направлении [001]

изменяются в достаточно широких пределах — от 8,4 до 11,1 Å.

Синтез новых летучих соединений и получение ориентированных слоев дают возможность управлять геометрическими характеристиками узора поверхности. Получение слоев соединений с известной структурной организацией может повлечь за собой разработку методик создания многослойных сложных объектов (метод эпитаксии атомных слоев), в том числе и с химическим взаимодействием между молекулами. Например, результаты исследования адсорбированных слоев дипивалоилметанатов Cu(II) и Ca(II) ме-

тодами ИК спектроскопии и EXAFS, проведенного в [9], показывают, что эти соединения выборочно и стехиометрически реагируют с гидроксильными группами на поверхности специально приготовленной подложки.

Таким образом, в данной работе осаждением в вакууме получены и рентгендифрактометрически исследованы слои октакис-(триметилсилокси)октасилсесквиоксана —  $[(CH_3)_3SiO]_8(SiO_{1,5})_8$ . Еще раз отметим, что мы имели дело с ориентированными поликристаллическими пленками, т.е. было только одно выделенное относительно поверхности образца направление расположения кристаллитов.

Геометрические характеристики слоев октаорганилсилсесквиоксанов

Соединение	$a \times b$ , Å	α, град	$d_{001}$ , Å
Метил-Т <sub>8</sub> [ 6 ]	8,432 × 8,432	95,66	8,34
Винил-Т <sub>8</sub> [ 7 ]	9,189 × 9,189	95,32	9,72
Этил-Т <sub>8</sub> [ 8 ]	$9,433 \times 9,433$	95,92	9,49
АТ <sub>8</sub> [ Наст. работа ]	11,046 × 11,104	77,68	13,15

Авторы выражают благодарность д.х.н. Р.Г. Мирскову за предоставленное вещество.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Проблемы* электронного материаловедения / Под ред. Ф.А. Кузнецова. Новосибирск: Наука, 1986. 162 с.
- 2. *Лаврентьев В.И.* Дис. ... докт. хим. наук. Полиэдрические олигосилсесквиоксаны. Синтез, исследование процесса образования, свойства, применение. Новосибирск: ИНХ СО РАН, 1996. 60 с.
- 3. Калмычков Г.В., Рахлин В.И., Гостевский Б.А. и др. // Докл. АН. 1998. 362, № 3. С. 359 361.
- 4. Auner N., Ziemer B., Herrschaft B. et al. // Eur. J. Inorg. Chem. 1999. P. 1087 1094.
- Громилов С.А., Прохорова С.А., Байдина И.А. // Журн. структур. химии. 1996. 37, № 5. С. 923 928.
- 6. Larson K. // Arkiv Kemi. 1960. 16. P. 203.
- 7. Байдина И.А., Подберезская Н.В., Алексеев В.И. и др. // Журн. структур. химии. 1979. **20**, № 4. С. 648 652.
- 8. Подберезская Н.В., Магарилл С.А., Байдина И.А. и др. // Там же. 1982. 23, № 3. С. 120 129.
- 9. Sekine R., Kawai M., Asakura K. et al. // Surface Sci. 1992. 278, N 1—2. P. 175 182.